



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 Pat ntschrift  
10 DE 198 36 770 C 1

91 Int. Cl. 7:  
G 06 K 9/38  
G 07 C 11/00  
A 61 B 5/00  
A 61 B 5/117

21 Aktenzeichen: 198 36 770.8-53  
22 Anmeldetag: 13. 8. 1998  
43 Offenlegungstag: -  
45 Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 20. 4. 2000

DE 198 36 770 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:  
Siemens AG, 80333 München, DE

72 Erfinder:  
Basse, Paul Werner v., Dipl.-Ing., 82515  
Wolfratshausen, DE; Willer, Josef, Dr., 85521  
Riemerling, DE; Scheiter, Thomas, Dr., 80469  
München, DE; Marksteiner, Stephan, Dr., 81739  
München, DE

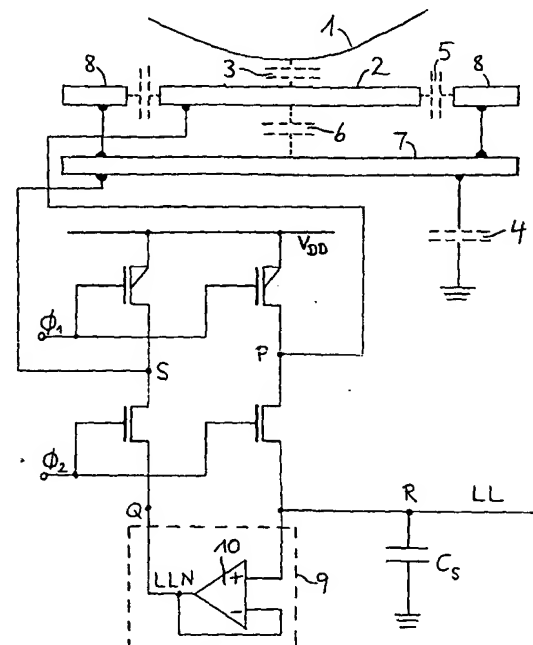
56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

DE 197 56 560 A1  
GB 22 44 164 A

N.D. Young et al.: "Novel Fingerprint Scanning  
Arrays Using Polysilicon TFT's on Glass and  
Polymer Substrates", IEEE Electron Device Letters,  
18, 19-20, 1997;  
M. Tartagni et al.: "A 390 dpi Live Fingerprint  
Imager Based on Feedback Capacitive Sensing  
Scheme  
IEEE International Solid-State Circuits Conference  
SSCC97, Session 12, Sensors, Paper FP 12.3, pp.  
200-201, 1997;

54 Verfahren zur kapazitiven Bilderfassung

57 Eine rasterförmige Anordnung von Leiterflächen wird  
zur kapazitiven Bilderfassung verwendet, wobei jeweils  
zwischen den zur Messung vorgesehenen Leitern (2) Ab-  
schirmleiter (8) verwendet werden. Während mehrerer  
Lade- und Entladezyklen wird immer das Potential auf  
den zu je einem Bildpunkt gehörenden Leitern mitgeführt,  
um Verschiebestrome zwischen den Abschirmkondensa-  
toren zu verhindern. Für die gleichartige Veränderung der  
elektrischen Potentiale auf diesen Leitern kann z. B. eine  
Kompensationsleitung mit einem rückgekoppelten Ope-  
rationsverstärker (9, 10) verwendet werden.



DE 198 36 770 C 1

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur kapazitiven Bilderfassung, das insbesondere zur Erfassung von Fingerabdrücken mittels kapazitiv messender Sensoren geeignet ist.

Bei kapazitiven Oberflächensensoren, z. B. bei Fingerabdrucksensoren, wird der Abstand zwischen dem zu messenden Objekt (z. B. die Oberfläche des Fingers) und dem Sensor durch eine rasterförmige Anordnung kleiner Leiterflächen (Pads) gemessen. Im Falle eines Fingerabdrucksensors sind diese Leiterflächen sehr klein und besitzen eine Abmessung von ca. 50 µm bis 100 µm. Derartige kapazitiv messende Fingerabdrucksensoren sind z. B. angegeben in dem Übersichtsartikel von M. Tartagni und R. Guerrieri: "A 390 dpi Live Fingerprint Imager Based on Feedback Capacitive Sensing Scheme" in ISSCC97, Seiten 200 und 201. Die Kapazitäten zum Meßobjekt sind sehr klein, so daß sich parasitäre Kapazitäten z. B. zum benachbarten Leiter oder zum Träger des betreffenden Sensors störend auf das Meßergebnis auswirken. Um die kleinen Meßsignale von den relativ großen Störsignalen trennen zu können, sind empfindliche Verstärker erforderlich. Die in den verstärkten Signalen enthaltenen Störsignale können entweder direkt meßtechnisch oder nach einer AD-Wandlung durch eine digitale Bearbeitung des erhaltenen Signales unterdrückt werden. Diese Maßnahmen sind aufwendig und erfordern eine hohe Genauigkeit.

In der DE 197 56 560 A1 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bilderfassung beschrieben, bei denen ein Fingerabdruckbild kapazitiv mittels eines Arrays aus Sensorelementen erfaßt wird. An zwei in unterschiedlichem Abstand zu dem Bild angeordnete Leiter wird je ein elektrisches Potential angelegt. Der Leiter, der sich näher zum Bild befindet, wird von dem betreffenden Potential getrennt, und an den Leiter, der sich in größerem Abstand vom Bild befindet, wird ein geändertes Potential angelegt. Mittels eines Komparators wird das sich auf dem ersten Leiter einstellende Potential mit einem Referenzpotential verglichen.

In der GB 2 244 164 A ist ein Fingerabdrucksensor beschrieben, bei dem die Kapazität zwischen einzelnen Sensorelementen einer Anordnung und den jeweils gegenüberliegenden Ausschnitten eines Fingerabdruckes bestimmt wird. Zu diesem Zweck sind in Reihen und Spalten angeordnete Elektroden vorhanden, die mit einer Isolationsschicht überdeckt sind. Eine elektronische Schaltung ermittelt die entsprechend der Fingerstruktur unterschiedliche Aufladung der einzelnen Leiterflächen bei Anlegen eines Potentials.

In der Veröffentlichung von N. D. Young et al.: "Novel Fingerprint Scanning Arrays Using Polysilicon TFT's on Glass and Polymer Substrates" in IEEE Electron Device Letters 18, 19-20 (1997) ist ein kapazitiv messender Fingerabdrucksensor beschrieben, bei dem zu jedem Bildpunkt eine Kondensatorelektrode und zwei Feldeffekttransistoren vorhanden sind, deren Drain-Anschlüsse mit der Kondensatorelektrode verbunden sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur kapazitiven Bilderfassung anzugeben, das insbesondere zur Erfassung von Fingerabdrücken geeignet und mit geringem technischen Aufwand durchführbar ist.

Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Es wird erfindungsgemäß eine Anordnung aus kapazitiv messenden Einzelsensoren verwendet, die jeweils Leiterflächen umfassen, die teils als Meßleiter vorgesehen sind, teils als Abschirmleiter verwendet werden, um die Kapazitäten der Einzelsensoren gegen Nachbarsensoren abzuschirmen.

Mittels als Schalter verwendeten Transistoren wird zyklisch ein vorgegebenes elektrisches Potential an sämtliche Leiter angelegt und die Ladung, die sich infolge der durch das Bild verursachten unterschiedlichen Kapazitäten zu den Meßleitern darauf ansammelt, auf einen Sammelkondensator abgeführt. Bei diesem Vorgang wird durch eine angeschlossene Kompensationsleitung, die bei der bevorzugten Ausführungsform einen rückgekoppelten Komparator aufweist, dafür gesorgt, daß das Potential auf den Leitern zumindest näherungsweise ausgeglichen bleibt, so daß keine elektrische Spannung an den Kondensatoren anliegt und eine vorhandene Aufladung nur durch eine weitere externe Kapazität, aber nicht durch unerwünschte Verschiebungsströme zwischen den Leitern zustande gekommen sein kann.

Eine Oberfläche eines zu erfassenden Bildes, das eine örtlich veränderliche Kapazität gegenüber den in dem Raster angeordneten Leitern hervorruft, wie das bei der Hautoberfläche eines Fingerabdruckes der Fall ist, wird während des Meßvorgangs parallel zu der Fläche der Leiter angeordnet. Es ergibt sich so eine unterschiedliche Aufladung der einzelnen Meßflächen entsprechend der Kapazität des vorhandenen Bildes. Mittels mehrmaligen Aufladens und Entladens der Kondensatoren der Einzelsensoren kann die sich jeweils darauf ansammelnde Ladung auf einem weiteren Kondensator soweit addiert werden, daß diese Ladungen mit geringem technischem Aufwand gemessen werden können. Die Leiter, einschließlich den als Schutzring vorgesehenen Leitern, liegen durch die verwendete Schaltung bedingt stets auf demselben Potential, so daß zwischen sämtlichen vorhandenen Leiterflächen keine Verschiebungsströme auftreten. Auf diese Weise wird erreicht, daß mit einer im Prinzip bekannten Sensoranordnung zur Bilderfassung auch Bilder wie z. B. Fingerabdrücke erfaßt werden können, die nur sehr geringe kapazitive Unterschiede hervorrufen.

Es folgt eine genauere Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand der Fig. 1 bis 3.

Fig. 1 zeigt ein Schema eines Einzelsensors mit einer für das Verfahren geeigneten Schaltung.

Fig. 2 zeigt Diagramme elektrischer Potentiale an verschiedenen Punkten der Schaltung aus Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Anordnung von für das Verfahren geeigneten elektrischen Leitern in Aufsicht.

In Fig. 1 ist im Schema eine für das Verfahren geeignete Anordnung von Leitern in zwei zueinander koplanaren Ebenen im Querschnitt dargestellt. Ein Ausschnitt einer Bildoberfläche 1, z. B. ein Steg eines Fingerabdruckes, befindet sich über einem Meßleiter 2 der oberen Leiterebene. Dieser Meßleiter 2 in jedem Einzelsensor ist zur Messung der Kapazität zwischen der Bildoberfläche 1 und dieser Leiterebene (Bild-Leiter-Kapazität 3) vorgesehen. In derselben Ebene befinden sich seitlich zu dem Meßleiter 2 weitere Leiter als obere Abschirmleiter 8. In einer zweiten Ebene ist dem Meßleiter 2 gegenüberliegend je ein weiterer Leiter angeordnet, der einen unteren Abschirmleiter 7 bildet und mit dem oberen Abschirmleiter 8 elektrisch leitend verbunden ist. Die zwischen dem Meßleiter 2 und dem oberen Abschirmleiter 8 vorhandene Abschirmkapazität 5 und die zwischen dem Meßleiter 2 und dem unteren Abschirmleiter 7 vorhandene Abschirmkapazität 6 sind wie die Bild-Leiter-Kapazität 3 gestrichelt eingezeichnet, um anzuzeigen, daß an diesen Stellen keine Kondensatorplatten vorhanden sind, sondern das Schaltbild für einen Kondensator gemeint ist. Den oberen Abschirmleiter 8 kann man sich in diesem Beispiel so vorstellen, daß er den Meßleiter 2 rings umgibt. Die beiden in Fig. 1 dargestellten Anteile des oberen Abschirmleiters 8 bilden dann den Querschnitt eines solchen rings um den Meßleiter 2 vorhandenen Abschirmleiters.

In Fig. 1 ist außerdem die zugehörige Schaltung, mit der

die Messung durchgeführt wird, als Beispiel eingezeichnet. Das erfindungsgemäße Verfahren wird in der Weise durchgeführt, daß zunächst in jedem Pixel des Bildfeldes die zugehörigen Leiter (Meßleiter und Abschirmleiter) auf ein bestimmtes Potential gelegt werden. Das geschieht mit der eingezeichneten Schaltung, indem die oberen eingezeichneten Transistoren über eine Taktsteuerung  $\Phi_1$  leitend geschaltet werden, so daß das Anschlußpotential  $V_{DD}$  an den eingezeichneten Punkten S und P und damit an den Leitern 2, 7, 8 des Einzelsensors anliegt. Über die zweite Taktsteuerung  $\Phi_2$  und die beiden unteren eingezeichneten Transistoren wird anschließend die Ladung auf den Leitern so abgeführt, daß soweit schaltungstechnisch möglich keine Potentialdifferenz zwischen dem Meßleiter 2 und den beiden Abschirmleitern 7, 8 auftritt.

Vorzugsweise wird das erreicht durch einen Schaltungsteil 9, der dafür sorgt, daß an den Punkten Q und R immer dasselbe Potential anliegt. Dieser Schaltungsteil 9 ist vorzugsweise mit einem rückgekoppelten Operationsverstärker 10 aufgebaut. Wenn über die Taktsteuerung  $\Phi_2$  die unteren eingezeichneten Transistoren leitend geschaltet werden, wird bewirkt, daß an den Punkten P und S der Schaltung ebenfalls dasselbe Potential anliegt. Das Potential wird bei einer bevorzugten Ausführung des Verfahrens für jedes Bildpixel, d. h. jeden Einzelsensor, gesondert in der beschriebenen Weise nachgeführt, so daß das Entstehen einer Potentialdifferenz an den Leitern verhindert wird. Auf diese Weise wird eine höhere Empfindlichkeit der Einzelmessung erreicht, weil Stör- oder Streukapazitäten abgeschirmt werden und unerwünschte Verschiebungsströme unterbunden sind. Außerdem wird das elektrische Feld zwischen den beiden Leiterebenen am Rand des Meßleiters 2 homogenisiert. Der untere Abschirmleiter 7 schirmt außerdem die Meßanordnung gegen eine parasitäre Kapazität ab, die z. B. durch ein Substrat, auf dem die Anordnung aufgebracht ist, hervorgerufen wird (Sensor-Untergrund-Kapazität 4 in Fig. 1). Als untere Abschirmleiter 7 können prinzipiell beliebige Gegenelektroden einer mehrlagigen Metallisierung verwendet werden.

Die nach jedem Ladezyklus durchgeführte Entladung der Meßanordnung erfolgt über einen Sammelkondensator  $C_S$ , auf dem die Ladungen gesammelt werden, bis die Ladung auf diesem Kondensator bzw. die an diesem Kondensator anliegende Spannung so groß ist, daß sie mit relativ geringem technischem Aufwand gemessen werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Bild-Leiter-Kapazitäten 3 ergeben sich von Bildpunkt zu Bildpunkt unterschiedliche Ladungen auf den Leitern. Entsprechend sind die auf den Sammelkondensatoren  $C_S$  gesammelten Ladungen für die einzelnen Bildpunkte verschieden, so daß sich aus der Bestimmung dieser Ladungen das Bild rekonstruieren läßt.

Vorzugsweise werden die einzelnen Bildpunkte über Leseleitungen LL nach Art des Zellenfeldes eines Matrixspeichers angesteuert. Eine derartige Anordnung ist aufwendig. Sie erfordert insbesondere einen Operationsverstärker 10 und eine Kompensationsleitung LLN pro Zeile der rasterförmigen Anordnung der Einzelsensoren.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich auch mit einer einfacheren Leiterstruktur durchführen, wenn man auf eine vollständige Kompensation der Potentialdifferenz zwischen den Meßleitern 2 und den Abschirmleitern 7, 8 verzichtet. Dann genügt ein Schaltungsteil 9 zur Kompensation, und man kommt mit einem Operationsverstärker 10 für alle Leseleitungen LL aus. Dieser Operationsverstärker wird dann von dieser einen Leseleitung LL z. B. in der Mitte des Zellenfeldes (rasterförmige Anordnung der Einzelsensoren) angesteuert. Da der Potentialverlauf während der Lade- und Entladevorgänge dem mittleren Verlauf dieser Vorgänge auf

den Einzelsensoren entspricht, wird in jedem Einzelsensor mit recht guter Genauigkeit kompensiert.

Eine weitere Möglichkeit, das Verfahren mit einer relativ einfachen Anordnung auszuführen, besteht darin, auf die Ansteuerung durch eine Leseleitung ganz zu verzichten. Alle Leseleitungen werden durch die zu messende Kapazität des Sensors simuliert, deren Ladung einfach auf den Sammelkondensator  $C_S$  abgeführt wird. Diese Ladungen werden meßtechnisch erfaßt, wenn sich genügend Ladungen nach mehreren Lade- und Entladezyklen darauf angesammelt haben. Die einfachste Form einer Kompensation ist die Festlegung auf eine feste Spannung. Man legt dazu den Punkt Q der Schaltung auf ein festes Potential und kommt dann ohne den Schaltungsteil 9 aus. Dieses Potential ist für alle Einzelsensoren gleich. Obwohl die Kompensationsleitung zu Anfang einen zu kleinen und am Schluß einen zu großen Spannungshub hat, ist im Mittel die Kompensation ausgeglichen. In den beiden beschriebenen Fällen mit gleichartiger Kompensation für alle Einzelsensoren kann die Ansteuerung vom Rand des Sensorfeldes her vorgenommen werden, was den Schaltungsaufwand stark vereinfacht.

In Fig. 2 sind die typischen Potentialverläufe an den einzelnen Punkten der in Fig. 1 dargestellten Schaltung wiedergegeben. Die Entladetakte  $\Phi_2$  sind jeweils gegenüber den Ladetakten  $\Phi_1$  zeitlich versetzt. Die Spannungsverläufe an den Punkten P und S sind aufgrund der vorgenommenen Kompensation gleich oder im Fall der vereinfachten Ausführung des Verfahrens mit vereinfachter Schaltung zumindest näherungsweise gleich. Die Spannung an den Punkten P bzw. S fällt bei den Entladungen auf einen immer geringeren Wert ab, da der Sammelkondensator  $C_S$  zunehmend geladen wird, und damit die minimale Spannung an den Punkten P bzw. S im Laufe der Zeit zunimmt. Die Potentiale an dem Punkt R und an dem Punkt Q, der über die Kompensation mit dem Potential am Punkt R mitgeführt wird, sind ebenfalls in Fig. 2 dargestellt.

Fig. 3 zeigt die rasterförmige Anordnung der jeweils für die Messung vorgesehenen Meßleiter 2 der oberen Leiterebene mit den oberen Abschirmleitern 8 dazwischen. Diese Abschirmleiter 8 sind hier als weiteres Beispiel als Streifen zwischen einzelnen Spalten 11 der matrixförmigen Anordnung eingezeichnet. Statt dieser Abschirmung zwischen einzelnen Spalten der Anordnung kann auch rings um die Meßleiter 2 je ein Abschirmleiter 8 entsprechend den gestrichelt eingezeichneten Berandungen vorhanden sein.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich unabhängig von der genauen Strukturierung der Leiter ausführen. Wesentlich ist dabei nur, daß zu jedem Bildpunkt eine Gruppe von Leitern vorhanden ist, von denen ein bestimmter Leiter der Bildoberfläche zugewandt ist und für die Messung vorgesehen ist, während die übrigen Leiter der Abschirmung dienen. Es muß eine Schaltung vorhanden sein, mit der das elektrische Potential auf den Abschirmleitern beim Laden und beim Entladen des Meßleiters dem Potential des Meßleiters nachgeführt werden kann. Die geometrische Anordnung der Abschirmleiter kann den jeweiligen Erfordernissen leicht angepaßt werden.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur kapazitiven Bilderfassung, bei dem
  - a) eine als Bild zu erfassende Fläche (1) rasterartig in Bildpunkte zerlegt wird, denen eine Anordnung elektrischer Leiter zugeordnet wird, die mindestens zu jedem Bildpunkt einen Meßleiter (2) und einen Abschirmleiter (7, 8) umfassen,
  - b) die als Bild zu erfassende Fläche (1) den Meßleitern (2) gegenüber angeordnet wird, so daß

zwischen den Bildpunkten und den Meßleitern (2) jeweils eine von dem betreffenden Bildpunkt abhängige Kapazität vorhanden ist,

c) an jedem Bildpunkt jeweils der Meßleiter (2) und der Abschirmleiter (7, 8) mit demselben elektrischen Potential verbunden und wieder getrennt werden,

d) an jedem Bildpunkt eine auf dem Meßleiter (2) und/oder auf dem Abschirmleiter (7, 8) vorhandene Ladung auf einen jeweiligen Sammelkondensator ( $C_S$ ) entladen wird, wobei gleichzeitig eine zwischen dem Meßleiter (2) und dem Abschirmleiter (7, 8) auftretende Potentialdifferenz ausgeglichen wird, und

e) die Schritte c und d wiederholt werden, bis die auf den Sammelkondensatoren ( $C_S$ ) angesammelten Ladungen mindestens einen für eine gesonderte Messung jedes Sammelkondensators als ausreichend vorgegebenen Wert aufweisen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Potentialdifferenz zwischen dem jeweiligen Meßleiter (2) und dem jeweiligen Abschirmleiter (7, 8) für alle Bildpunkte gleichartig ausgeglichen wird, indem die Abschirmleiter (7, 8) auf dasselbe vorgegebene Potential gelegt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Potentialdifferenz zwischen dem jeweiligen Meßleiter (2) und dem jeweiligen Abschirmleiter (7, 8) für alle Bildpunkte gesondert ausgeglichen wird, indem an den jeweiligen Abschirmleiter (2) stets dasselbe Potential angelegt wird, das gerade an dem Meßleiter (2) anliegt.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

35

40

45

50

55

60

65

U  
P  
T

- Leerseite -

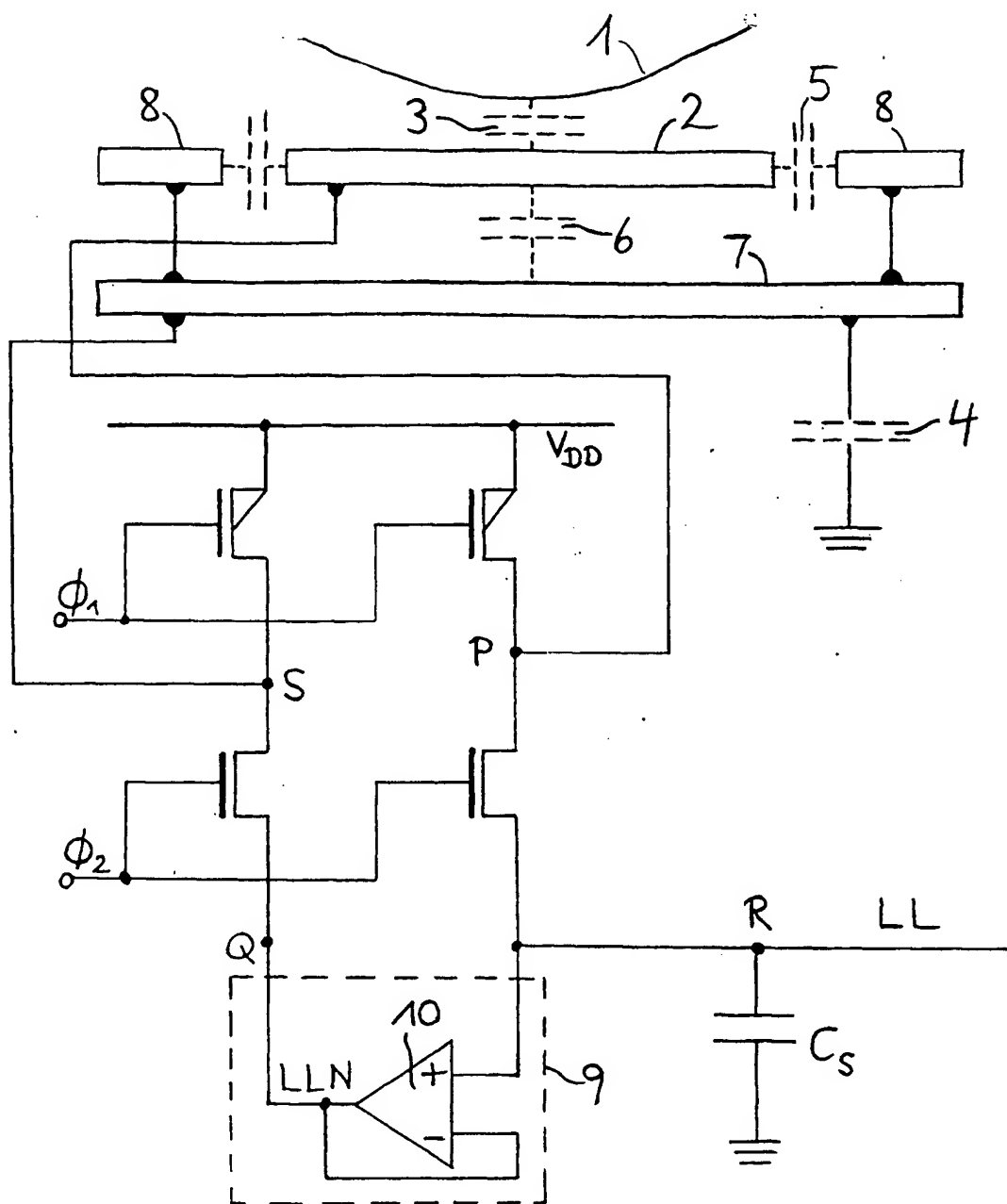


Fig. 1

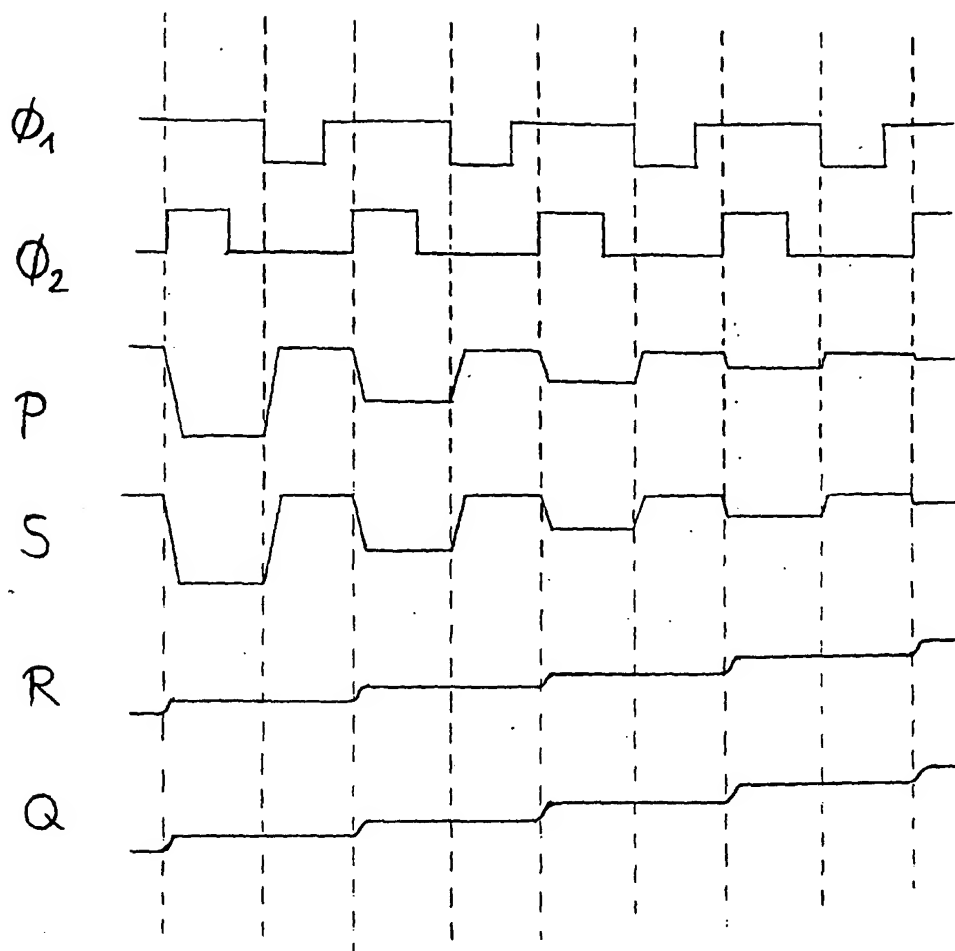


Fig. 2

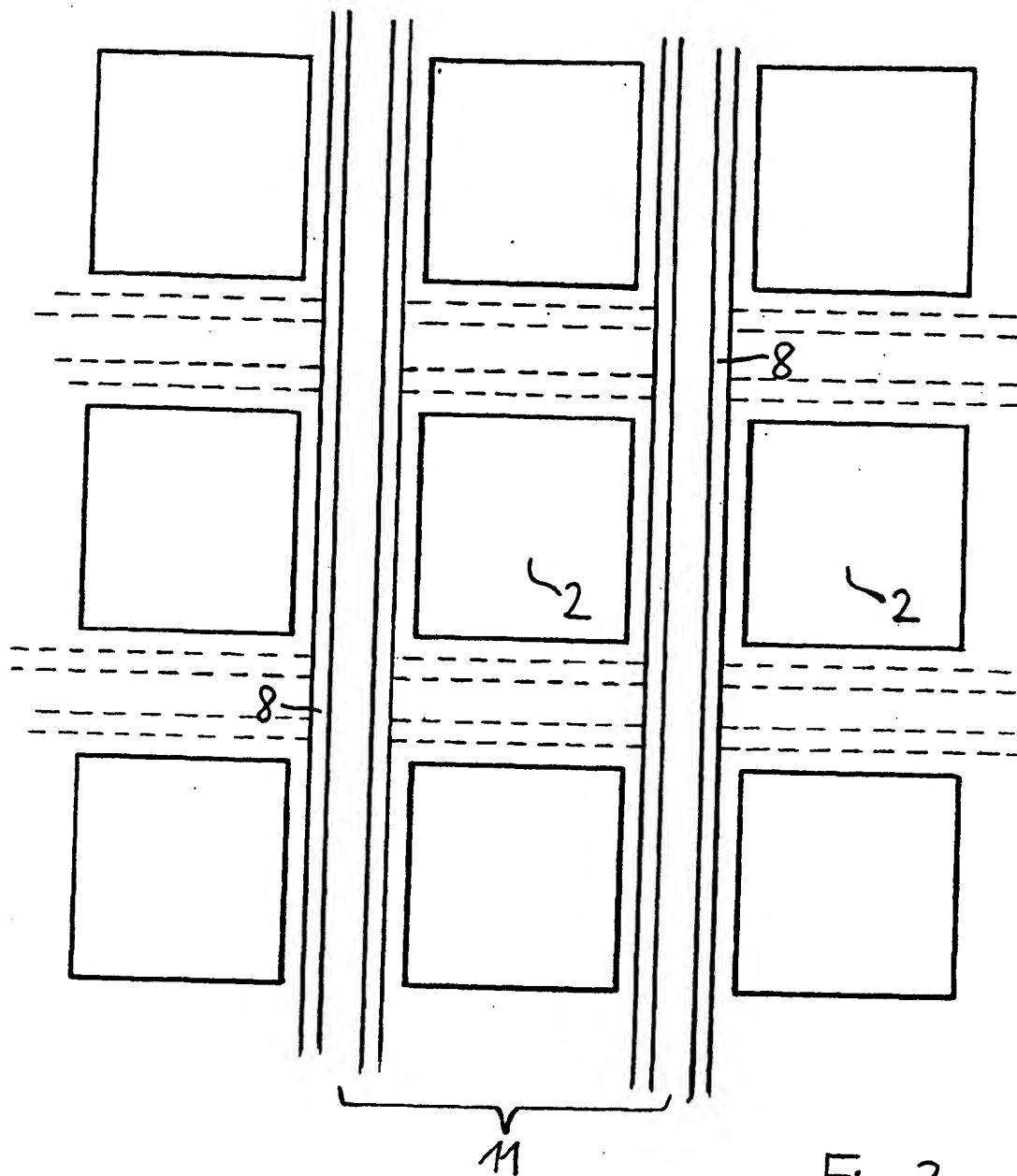


Fig 3



**M th d for capacitiv imag acquisiti n**

Patent Number: US2001022337  
Publication date: 2001-09-20  
Inventor(s): BASSE PAUL-WERNER VON (DE); MARKSTEINER STEPHAN (DE); SCHEITER THOMAS (DE); WILLER JOSEF (DE)  
Applicant(s):  
Requested Patent: DE19836770  
Application Number: US20010782733 20010213  
Priority Number(s): DE19981036770 19980813; WO1999DE02523 19990812  
IPC Classification: H01L27/00  
EC Classification: G06K9/00A1A  
Equivalents: EP1110169 (WO0010205), A3, B1, ES2173760T, JP2002522797T, RU2192665, US6365888, WO0010205

---

**Abstract**

---

A grid-shaped array of conductor areas is used for capacitive image acquisition. Shielding conductors are disposed in each case between the conductors that are provided for measurement. During a plurality of charging and discharging cycles, the potential is always carried along on the conductors belonging to a respective pixel in order to prevent displacement currents between the shielding capacitors. By way of example, a compensation line with a feedback operational amplifier can be used for identically altering the electrical potentials on the conductors

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

DOCKET NO: L&L-10183

SERIAL NO: \_\_\_\_\_

APPLICANT: M. Groschitz et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100